

Если  $\chi < \delta_g$ , но больше энергии оптического фона (  $\hbar\omega \sim 10^{-2}$  эВ), то ударная ионизация невозможна и фотоэлектроны теряют свою энергию на генерацию оптических фононов. При таком рассеянии длина свободного пробега электрона составляет всего несколько нм, однако в одном акте рассеяния теряется лишь малая часть энергии ( $\sim 10^{-2}$  эВ). Поэтому длина, на которой фотоэлектрон рассеивается значит, часть своей энергии и теряет возможность выйти в вакуум (глубина выхода), оказывается значительно больше и в ряде случаев достигает неск. десятков нм. Квантовый выход  $Y$  растёт с уменьшением  $\chi$  и при  $\chi \ll \delta_g$  может достигать величины  $\geq 10^{-1}$  электрон/фотон. Все эф. фотокатоды (квантовый выход  $\geq 0,1$  электрон/фотон) являются полупроводниками с малым положит. или отрицат. электронным состоянием.

Дырочные полупроводники имеют более высокий квантовый выход Ф. э., чем электронные, что объясняется существованием приповерхностного пространственного заряда и связанного с ним электрического поля. В электронных полупроводниках приповерхностное электрическое поле тормозит фотоэлектроны и препятствует их выходу в вакуум. Напротив, в дырочных полупроводниках электрическое поле ускоряет фотоэлектроны к поверхности и способствует их выходу в вакуум. Все эф. фотокатоды являются полупроводниками  $p$ -типа.

В случае дырочных полупроводников, где вблизи поверхности энергетич. зоны изогнуты вниз (электрическое поле ускоряет фотоэлектроны), снижение  $\chi$  может привести к тому, что, хотя  $\chi > 0$ , уровень вакуума (энергия покоящегося электрона в вакууме) оказывается ниже дна зоны проводимости в объеме полупроводника. В такой ситуации говорят об отрицат. электронном состоянии (ОЭС).

При Ф. э. из полупроводников с ОЭС в вакуум могут выйти не только горячие электроны, как в обычных полупроводниках, но и электроны, возбужденные светом на дне зоны проводимости или термализованные в зоне проводимости полупроводника (рис. 3). Термализованные электро-



Рис. 3. Энергетическая схема приповерхностной области полупроводников с ОЭС. Стрелками показан выход в вакуум горячих (1) и термализованных (2) электронов.

ны подходят к поверхности полупроводника из глубины, равной диффузионной длине неосновных носителей заряда, в  $k$ -рая в десятки раз больше глубины выхода горячих электронов и превышает глубину поглощения света даже в области спектра вблизи края фундаментального поглощения. Т. о., даже те электроны, которые генерируются светом в глубине полупроводника, могут выйти в вакуум. Проходя в процессе Ф. э. приповерхностную область изгиба зон, электроны становятся горячими и могут, потеряв часть своей энергии, опуститься ниже уровня вакуума и не дать вклад в фототок. Однако при сильном легировании полупроводников ширина области изгиба зон может быть сделана меньше длины свободного пробега горячих электронов, что резко уменьшает эффекты рассеяния в области изгиба зон. В результате длинноволновая граница Ф. э. из полупроводников в этом случае соответствует ширине запрещенной зоны полупроводника, а квантовый выход Ф. э. оказывается большим во всей области их фоточувствительности ( $\hbar\nu > \delta_g$ ). Форма спектральной характеристики квантового выхода Ф. э. из полупроводников с ОЭС вблизи порога описывается выражением

$$Y = \frac{(1-R)B}{1 + 1/\alpha L}$$

Здесь  $R$  — коэф. отражения,  $\alpha$  — коэф. оптического поглощения,  $L$  — диффузионная длина электронов,  $B$  — вероятность выхода фотоэлектронов в вакуум, т. е. вероятность прохождения области изгиба зон и границы раздела полупроводник — вакуум. Обычно  $B$  лежит в пределах  $0,05 \div 0,5$ .

Исследования Ф. э. из полупроводников с ОЭС впервые проведены Широм и ван Лааром в 1965 на монокристаллах  $p$ -GaAs, сколотых в сверхвысоком вакууме и покрытых монослоем Cs. Была получена Ф. э. с длинноволновой границей, соответствующей  $\delta_g$  ( $\lambda_0 \approx 0,9$  мкм) и высоким квантовым выходом. В дальнейшем исследования Ф. э. из эпитаксиальных пленок GaAs, поверхность которых очищалась прогревом в сверхвысоком вакууме, а также использование для снижения работы выхода не только цезия, но и кислорода позволили довести величину квантового выхода Ф. э. из GaAs с ОЭС до  $30 \div 40\%$ . Ф. э. с высоким квантовым выходом в области спектра до  $\lambda = 1,1$  мкм была получена при реализации ОЭС в Si и полупроводниковых твердых растворах соединений  $A^{III}B^{V}$  (GaInAs, InAsP, InGaAsP) (рис. 4).

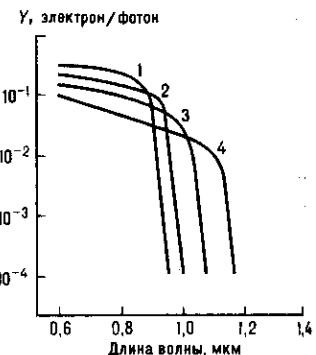


Рис. 4. Спектральные характеристики квантового выхода фотоэмиссии из полупроводников с ОЭС:

$Ga_{1-x}In_xAs - Cs - O$ .  
1 —  $\delta_g = 1,43$  эВ; 2 —  $\delta_g = 1,28$  эВ; 3 —  $\delta_g \approx 1,18$  эВ; 4 —  $\delta_g = 1,08$  эВ.

Зонная структура GaAs и нек-рых др. полупроводниковых соединений типа  $A^{III}B^{V}$  такова, что при освещении их светом с круговой поляризацией возбужденные электроны в зоне проводимости оказываются поляризованными по спину, причем степень поляризации составляет 50%. В случае ОЭС такие электроны могут выйти в вакуум, образуя пучок спин-поляризованных электронов. Степень поляризации этих электронов, эмитированных из GaAs с ОЭС, достигает  $40 \div 49\%$ .

Энергетич. распределение фотоэлектронов отражает структуру начальных и конечных состояний, между которыми происходит электронный переход при поглощении фотона, а также механизм рассеяния фотоэлектронов в процессе их движения к поверхности.

Сильное электрическое поле (внешнее и внутреннее) влияет на Ф. э. из полупроводников. Внеш. электрическое поле в соответствии с эффектом Шоттки снижает величину  $\chi$  и тем самым сдвигает порог Ф. э. в длинноволновую часть спектра и повышает величину квантового выхода Ф. э. вблизи порога. Внутр. электрическое поле вблизи поверхности полупроводника ускоряет фотоэлектроны к поверхности, также увеличивая квантовый выход Ф. э. Если электрическое поле достаточно сильное, выйти в вакуум смогут даже фотоэлектроны, находящиеся в объеме полупроводника вблизи дна зоны проводимости ниже уровня вакуума. Дополнит. энергию, необходимую для выхода в вакуум, фотоэлектроны приобретают в электрическом поле. При этом порог Ф. э. будет определяться шириной запрещенной зоны полупроводника ( $\hbar\nu_0 \approx \delta_g$ ),  $k$ -рая может быть значительно меньше, чем  $\Phi$ . Для создания областей сильного электрического поля обычно используют полупроводниковые структуры с  $p$ - $n$ -переходами и контактами полупроводник — металл (см. Контактные явления в полупроводниках). На рис. 5 представлены спектральные характеристики Ф. э. из контакта полупроводник — металл  $p$ -InGaAs — Ag. Работа выхода пленки Ag снижена адсорбцией цезия и кислорода до  $\Phi \approx 1,1$  эВ. При обратном смещении на контакте